Requested document:

JP3116693 click here to view the pdf document

DISCHARGE LAMP LIGHTING DEVICE	
Patent Number:	
Publication date:	1991-05-17
Inventor(s):	SUGANO TOSHIYA; KAWASHIMA HIDEMASA; KAMEYAMA EIJI
Applicant(s):	IWASAKI ELECTRIC CO LTD
Requested Patent:	☐ <u>JP3116693</u>
Application Number:	JP19890254867 19890929
Priority Number(s):	JP19890254867 19890929
IPC Classification:	H05B41/16; H05B41/29
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
Abstract	
PURPOSE:To lessen beat resulting from a pulse transformer by reducing current supplied from a chopper circuit in synchronization with on-off switching timings for a switching element in a bridge inverter circuit. CONSTITUTION:A control circuit 9 by which the first drive circuit 7 is controlled is provided for reducing current supplied from a chopper circuit 2 in synchronization with on-off switching timings for a switching element 21 in a bridge inverter circuit 3. Current supplied into a load circuit 4 connected to the bridge inverter circuit 3 is therefore gradually varied and inversed to moderate magnetic variation in a pulse transformer in the load circuit 4. It is thus possible to lessen beat resulting from the pulse transformer.	
Data supplied from the esp@cenet database - I2	

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出顧公開

❸公開 平成3年(1991)12月3日

☞ 公開実用新案公報(U) 平3-116693

. 9 110000

(a) Int. Cl. 5 H 05 B 6/68 F 24 C 7/02 識別記号 j

庁内整理番号 8815-3K 7153-3L

3 1 0 B 3 1 5 E 3 5 0 A 5 2 1 N

7153-3L 7153-3L 7153-3L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

**😡考案の名称** 高周波加熱装置

②実 願 平2-25805

❷出 願 平2(1990)3月14日

**20**考案者 大内 光生

\* 4 **大阪** 

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

の出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 青山 葆 外1名

- 1. 考案の名称
  - 高周波加熱装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 扉を有する加熱室内のトレイに載せられる被加熱物に、マグネトロンで発生させたマイクロ波を照射し、加熱室内の空気をファンで換気して被加熱物を加熱する高周波加熱装置において、

上記扉の開閉を検知する開閉検知スイッチと、上記トレイに載せられた被加熱物の重量を検出する重量センサと、所定時間を計時するタイマと、加熱終了時に上記重量センサからの検出信号に基づいて被加熱物の重量に応じたファン運転時間を所定の数式で算出し、算出したファン運転時間を上記タイマに計時させ、かつタイマの計時中だけ上記ファンを駆動するとともに、加熱終了後に上記開榜知スイッチから開検知信号が入力されたとき、上記重量センサからの検出信号が一定値以上変化するかを判断し、一定値以上変化した場合、運転中のファンを停止させる制御手段を備



えたことを特徴とする髙周波加熱装置。

#### 3. 考案の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本考案は、加熱室内の被加熱物にマイクロ波を 照射し、加熱室内の空気をファンで換気して被過 熱物を加熱する高周波加熱装置に関する。

<従来の技術>

従来、この種の高周波加熱装置として、例えば第5図に示すようなものが知られている。この装置は、加熱室1内のトレイ4に載せられた被加熱物としての食品Aに、マグネトロン6で発生させたマイクロ波を照射して食品を加熱するとともに、食品Aから発せられた水蒸気が扉の窓ガラス3(第1図参照)に結びするのを防ぐため、ファン7(第1図参照)により吸い込んでマグネトロン6を冷却した後の外気を、加熱室1内に図中の矢印の知く流して、排気ダクト9から外部へ排出している。加熱室1内の食品Aは、加熱終了後も自然冷却されるまでは水蒸気を発生し続け、上述と同様の結びの関れがあるため、上記ファン7は、扉2(第

I 図参照)の開閉を検知するスイッチ10が加熱 終了後に初めて開扉を検知するまで、継続して運 転されるようになっている。

<考案が解決しようとする課題>

ところが、上記従来の高周波加熱装置は、加熱 終了後に加熱室1の扉2が開かれれば、食品Aは 取り出されたものとして無条件でファン7の運転 を停止するものであるため、開扉で食品Aが取り 出されず加熱室1内に残った場合でも、ファン7 が止まって、食品から発せられる水蒸気で窓ガラ ス3に結び生じるという欠点がある。また、加 熱を了後に扉2が全く開かれなければ、食品が加 熱室1内で自然冷却した後もファン7が駆動され 続けるという欠点がある。

そこで、本考案の目的は、被加熱物が加熱終了後に加熱室内に残っているか否かを直接的手段で検出し、その検出結果に基づいてファンの運転を制御することによって、加熱終了後の加熱室の換気を最適に行なうことができる高周波加熱装置を提供することにある。



<課題を解決するための手段>

上記目的を達成するため、本考案の髙周波加熱 装置は、扉を有する加熱室内のトレイに載せられ る被加熱物に、マグネトロンで発生させたマイク 口波を照射し、加熱室内の空気をファンで換気し て被加熱物を加熱するものにおいて、上記扉の開 閉を検知する開閉検知スイッチと、上記トレイに 載せられた被加熱物の重量を検出する重量センサ と、所定時間を計時するタイマと、加熱終了時に 上記重量センサからの検出信号に基づいて被加熱 物の重量に応じたファン運転時間を所定の数式で 算出し、算出したファン運転時間を上記タイマに 計時させ、かつタイマの計時中だけ上記ファンを 駆動するとともに、加熱終了後に上記開閉検知ス イッチから開検知信号が入力されたとき、上記重 量センサからの検出信号が一定値以上変化するか 否かを判断し、一定値以上変化した場合、運転中 のファンを停止させる制御手段を備えたことを特 徴とする。

<作用>

加熱室内のトレイに載せられた被加熱物のマイ クロ波照射による加熱が終了すると、終了と同時 に制御手段は、重量センサからの検出信号に基づ いて被加熱物の重量に応じたファン運転時間を所 定の数式で算出し、算出したファン運転時間をタ イマに計時させ、かつタイマの計時中だけファン を駆動して、加熱終了後も加熱室内の空気を換気 する。この換気中に加熱室の扉が開かれると、開 閉検知スイッチが開検知信号を制御手段に出力し、 これを受けた制御手段は、重量センサからの検出 信号が一定値以上変化するか否かを判断する。即 ち、制御手段は、開かれた扉から被加熱物が取り 出されれば肯と、取り出されなければ否と判断し、 肯つまり取り出されたと判断すれば、運転中のファ ンを停止させる一方、否つまり残っていると判断 すれば、上記タイマが計時を終えるまでファンを 駆動し、被加熱物の重量が大きいほど長いファン 運転時間の経過後ファンを停止させる。

<実施例>

以下、本考案を図示の実施例により詳細に説明

する。

第1図は外ケースを取外した高周波加熱装置の一実施例を示す斜視図であり、1は前面にガラス窓3をもつ扉2を開閉自在に取り付けた加熱室、4はこの加熱室1の底面に設けたトレイ、5はこのトレイ4に載せられる被加熱物の重量を検出する重量センサ、6は上記トレイ4に向けてマイクロ波を照射するマグネトロン、7はこのマグネトロン6を冷却するとともに給気ダクト8および排気ダクト9を介して加熱室1内を換気するファイクト9を介して加熱室1内を換気するファイクト11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチ、11は上記重量センサ5および開閉検知スイッチを制御手段としてのマイクロコンピュータである。

上記加熱室1は、第2図に示すように、重量センサ5をトレイ4の下方に設けた点を除いて第5図で述べた従来例と同じ構成であり、同じ構成部材には同一番号を付している。また、ファンによる換気の流れは、第5図と同様図中の矢印の如く



なる。

第3図は上記重量センサ5の詳細断面図である。この重量センサ5は、加熱室の底板1aの下面にケース12を固定し、このケース12内の片面に水平に突設した2枚の板ばね13,13により、トレイ4の中心シャフト14の下端14aを挟持してトレイ4を昇降自在に保持する一方、ケース12内の他の片面に上電極15を、これに僅かな間隔をあけて対向するようにシャフト下端14aに下電極16を夫々水平に突設して、両電極15、16間の電気容量の変化でトレイ4上の被加熱物Aの重量を検出するようになっている。

上記マイクロコンピュータ11は、加熱終了時に重量センサ5からの検出信号に基づいてトレイ4に載せられた食品等の被加熱物Aの重量Wiに応じたファン運転時間Ti(重量が大きいほどTiは長くなる)を予めプログラムで与えられた数式で算出し(第4図S1~S3参照)、算出したファン運転時間Tiを内蔵のタイマに計時させ、かつタイマの計時中だけファン7を駆動するとともに



(第4図S4参照)、加熱終了後に開閉検知スイッチ10から開検知信号が入力されたとき(第4図S5参照)、重量センサ5からの検出信号が一定値以上変化するか否か、即ち開扉後の重量Wzと最初の重量Wzの差の絶対値 | Wz | が一定値Wo以上か否かを判断し(第4図S7参照)、一定値以上変化した場合、運転中のファン7を停止させる(第4図S8参照)ようになっている。

上記構成の高周波加熱装置の動作について、第 4図のフローチャートを参照しつつ次に述べる。

加熱室1内のトレイ4に載せられた被加熱物Aのマイクロ波照射による加熱が終了すると(ステップS1参照)、終了と同時にマイクロコンピュータ11は、重量センサ5からの検出信号に基づいて被加熱物Aの重量W<sub>1</sub>(ステップS2参照)に応じたファン運転時間T<sub>1</sub>を所定の数式で算出し(ステップS3参照)、このファン運転時間T<sub>1</sub>をタイマに計時させ、かつタイマの計時中だけファン7を駆動して、加熱終了後も加熱室1内の空気を水蒸気排出のため換気する(ステップS4参照)。こ



の換気中に加熱室1の扉 2 が開かれると、開閉検知スイッチ16が開検知信号をマイクロコンピュータ11に出力し(ステップS5参照)、これを受けたマイクロコンピュータ11は、重量センサ5の検出信号が表わす開扉後の重量W₂(ステップS6参照)と、最初の重量W₁の差の絶対値 | W₁ーW₂ | が一定値W₀以上か否かを判断し(ステップS7参照)、一定値W₀以上である場合、被加熱物Aが取り除かれ、あるいは新たな被加熱物に置き替えられたと判断して、運転中のファン7をタイマ計時中でも停止させる(ステップS8参照)。

こうして、加熱終了後に扉2が開かれず、加熱室1内に被加熱物Aが放置された場合は、その被加熱物Aの重量Wiが大きいほど長くなる所定時間Tiだけファン7が運転されて、加熱終了後も被加熱物から発せられる水蒸気を過不足なく排出し、窓ガラス3等への結構や高周波加熱装置外への水滴の垂れ落ちがなくなる。また、ファン運転中に扉2が開かれ、被加熱物Aが取り出され、あるいは置き替えられた場合は、ファン7が確実に

停止せしめられて、不必要で無駄なファン運転がなくなる。つまり、第5図の従来例でみられた欠点が解消され、加熱終了後の加熱室1の換気が最適に行なわれるのである。

なお、本考案が図示の実施例に限られないのは いうまでもない。

#### <考案の効果>

以上の説明で明らかなように、本考案の高周波加熱装置は、マグネトロンによる加熱終了時に、制御手段によって、重量センサが検出した被加熱物の重量に応じたファン運転時間をタイマに数計で、第出し、アン運転時間をタイマを換けれて、変動するとともに、駆動中に扉開開き、コスイッチからの検出信号が入力されたを判断し、一定値以上変化した場合、取動中のファンを停止させるようにしているのでからかからで発した。これを対過不足なく外部へ排出され、窓気が過不足なく外部へ排出され、窓



ガラスへの結びや装置外への水垂れが防止できる とともに、無駄なファン運転が防止されて省エネ ルギーに寄与できる。

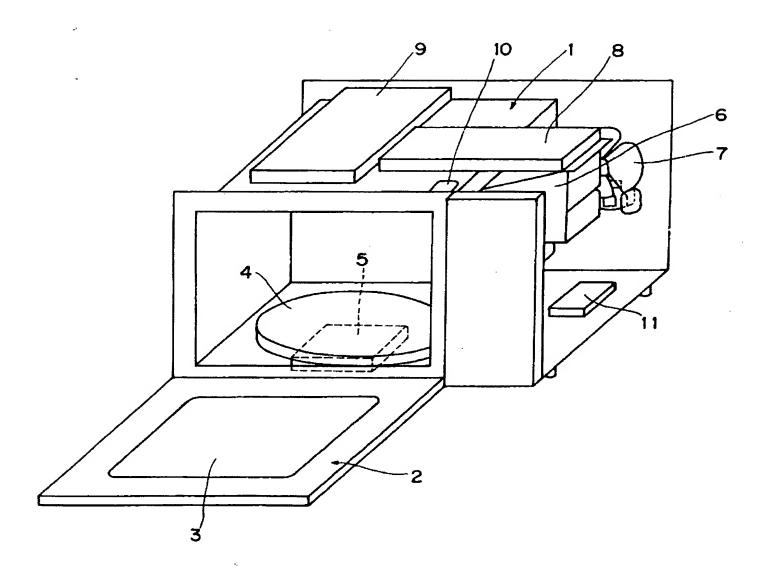
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の高周波加熱装置の一実施例を示す斜視図、第2図は上記実施例の加熱室の詳細断面図、第3図は上記実施例の重量センサの詳細断面図、第4図は上記実施例の動作を示すフローチャート、第5図は従来の高周波加熱装置の概略断面図である。

- 1…加熱室、2…扉、3…窓ガラス、
- 4 …トレイ、5 … 重量センサ、
- 6…マグネトロン、7…ファン、
- 10…開閉検知スイッチ、
- 11…マイクロコンピュータ、A…被加熱物。

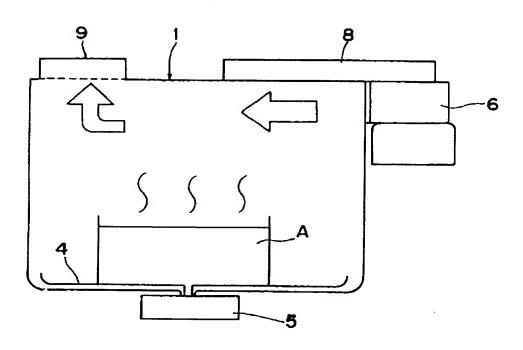
実用新案登録出願人 シャープ株式会社 代 理 人 弁理士 青山 葆 ほか1名

第 1 図

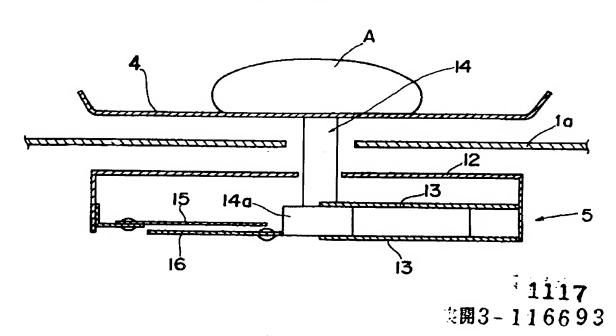


**1116** 実開3-116693

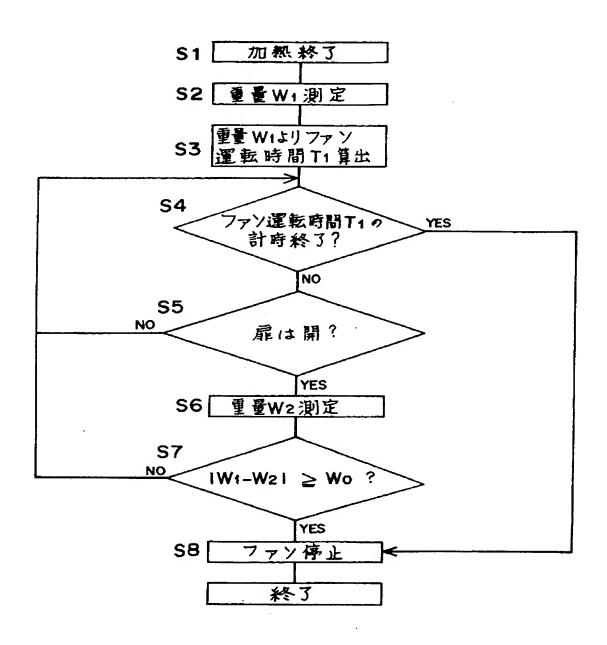
第 2 図



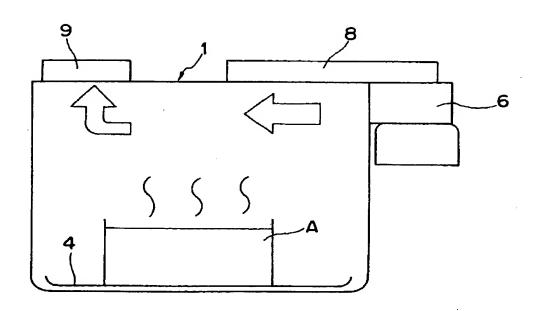
第3図



第 4 図



1118 実開3-116693



実用新案登録出願人 シヤープ株 式 会 社 代理人 弁理士 青山 葆 外1名 実開3-116693